

X線回折法による 薄膜評価セミナー

下記の通り、薄膜X線回折セミナーを開催いたします。
事前予約不要、参加費無料ですので、ぜひご参加ください。

講師 **株式会社リガク 西郷 真理 氏**

日時 平成30年2月20日 (火)

10:00 ~ 15:40

場所: **工学研究院フロンティア応用科学研究棟
1Fセミナー室1**

9:45 ~ 10:00

受付

10:00 ~ 10:05

開会の挨拶

10:05 ~ 11:45

X線回折法による薄膜評価

- X線回折の基礎
- 薄膜X線回折の基礎
- X線を用いた薄膜評価の発展形

11:45 ~ 13:30

休憩

13:30 ~ 14:40

逆格子マップによるエピタキシャル
薄膜の評価

- X線回折を用いたエピタキシャル膜の評価
- 逆空間の考え方
- 逆格子マップ測定

14:40 ~ 15:30

高分解能ロックングカーブ測定による
エピタキシャル薄膜の評価

15:30 ~ 15:40

閉会の挨拶

主催: 電子科学研究所 ナノテク連携推進室
創成科学研究機構 GFCオープンファシリティ部門
工学研究院 高エネルギー超強力X線回折室

世話人: 松尾保孝 (内線9340)

共催: 北海道大学 微細加工プラットフォーム



<http://www.eng.hokudai.ac.jp/labo/masaou/>

MASAOU

検索

共催: 北海道大学大学院工学研究院
マテリアル分析・構造解析共用ユニット
(Material Analysis and Structure Analysis Open Unit)
問い合わせ先: 工学研究院材料化学棟1F MC104
MASAOU事務室
Tel: 011-706-8175(内線8175)
Email: masaou@eng.hokudai.ac.jp